

Příloha č. 1 Prováděcí dohody – Specifikace přístrojů a zařízení

Přístroj A/N	Inventární číslo	Celistvý název EN	Název dle účetního systému	Výrobce	Typové označení	Vlastník
A	317433	Optical microscope Olympus MX51	Mikroskop průmyslový optický MX51-F	Olympus	MX51	VUT
A	317444	Spectroscopic reflectometer Ocean Optics NanoCalc 2000	Reflektrometr NC2000-UV/VIS/NIR	Ocean Optics	NanoCalc 2000	VUT
A	317520	Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscope TESCAN LYRA3	Mikroskop elektronový s fokusovým iontovým svazkem	TESCAN	LYRA3	VUT
A	317786	Scanning Near-field Optical Microscopy Nanonics Imaging MV 4000	Rastrovací mikroskop blízkého pole	Nanonics Imaging	MV 4000	VUT
A	317787	Wire bonder TPT HB 16	Kontaktovací zařízení HB 16	TPT	HB 16	VUT
A	317806	X-ray powder diffractometer Rigaku SmartLab 3kW	Difraktometr pro práškové materiály - typ B (1D)	Rigaku	SmartLab 3kW	VUT
A	318073	Scanning Electron Microscope/E-beam writer TESCAN MIRA3	Elektronový mikroskop pro litografické aplikace	TESCAN	MIRA3	VUT
A	318501	UV Direct Write Laser system Heidelberg Instruments DWL 66-fs	UV optický litograf s přímým laserovým zápisem	Heidelberg Instruments	DWL 66-fs	VUT
A	318523	Resist stripper Diener electronic NANO Plasma cleaner	Zařízení REI odstraňovač rezistu	Diener electronic	NANO Plasma cleaner	VUT
A	318542	Scanning Probe Microscope Bruker Dimension Icon	Litografický rastrovací sondový systém	Bruker	Dimension Icon	VUT
A	318547	Mechanical profilometer Bruker Dektak XT	Mechanický profilometr Bruker Dektak XT	Bruker	Dektak XT	VUT
A	319095	Semi-automated 4-probe system Cascade Microtech SUMMIT 12000	Polovodič. charakterizační systém KEITHLEY 4200-SCS	Cascade Microtech	SUMMIT 12000	VUT
A	319096	4-probe station Cascade Microtech MPS 150	Kontaktovací stanice MPS150-M	Cascade Microtech	MPS 150	VUT
A	319159	E-beam writer RAITH RAITH150 Two	Elektronový litograf RAITH	RAITH	RAITH150 Two	VUT
A	319225	Low Temperature Electro-Magnetic Properties Measurement System LakeShore CRX-EM-HF	Nízkoteplotní systém pro měření elektromagnetických vlastností	LakeShore	CRX-EM-HF	VUT
A	319265	Optical microscope Zeiss Axio Imager A2	Mikroskop inspekční Axio Imager A2 MAT	Zeiss	Axio Imager A2	VUT
A	319266	Optical microscope Zeiss Axio Scope Vario	Mikroskop screeningový Axio Scope MAT	Zeiss	Axio Scope Vario	VUT
A	319267	Stereo microscope Zeiss STEMI 508	Mikroskop pracovní Stemi 508	Zeiss	STEMI 508	VUT
A	319288	Low Temperature Vibrating Sample Magnetometry Cryogenic Limited	Zařízení pro elektrická a magnetická měření CFMS	Cryogenic Limited		VUT
A	319312	High vacuum coating system for electron microscopy Leica Microsystems EM ACE 600	Naprašovací zařízení Leica EM ACE600	Leica Microsystems	EM ACE 600	VUT
A	319344	Secondary Ion Mass Spectroscopy ION-TOF TOF.SIMS5	Hmotnostní spektroskopie TOF.SIMS 5-100	ION-TOF	TOF.SIMS5	VUT
A	319344	Ultra High Vacuum Preparation and Analytical System - Low Energy Ion Spectroscopy ION-TOF Qtac 100	Vysokovakuový preparační a analytický systém - nízkenergieová iontová spektroskopie	ION-TOF	Qtac 100	VUT
A	319347	Reactive ion etching of III-V semiconductors Oxford Instruments Plasma Technology PlasmaPro 100	Vaku.systém pro leptání kovů,III-IV materiálů	Oxford Instruments Plasma Technology	PlasmaPro 100	VUT
A	319348	Deep reactive ion etching of Si-based materials Oxford Instruments Plasma Technology PlasmaPro 100	Vaku.systém pro hluboké leptání křemíku	Oxford Instruments Plasma Technology	PlasmaPro 100	VUT
A	319351	Metallographic saw Labotom 5	Rozbrušovací pila pro hrubé dělení LABOTOM 5	Struers	Labotom 5	VUT
A	319352	Grinder/polisher Tegramin 30	Poloautomat pro mechan.přípr.metalograf.výbrusů	Struers	Tegramin 30	VUT
A	319353	Precision saw Accutom 100	Malá pila pro přesné dělení ACCUTON 100	Struers	Accutom 100	VUT
A	319354	Mounting press Citopress 10	Preparační lis Citopress 10	Struers	Citopress 10	VUT
A	319355	TEM electrolytical polisher Tenupol 5	Elektrolytická leštička TEM fólií TENUPOL 5	Struers	Tenupol 5	VUT
A	319356	Inverted light microscope Zeiss Axio Observer Z1m	Systém světelné mikroskopie AxioObserver Z1.m	Zeiss	Axio Observer Z1m	VUT
A	319357	Vacuum impregnation chamber Citovac	Vakuová impregnační stanice CITOvac	Struers	Citovac	VUT
A	319358	Chiller Lauda RP 870	Chladicí smýčka LCK 1895	Lauda	RP870	VUT
A	319359	Electrolytical polisher Lectropol 5	Elektrolytická leštička metalografických vzorků	Struers	Lectropol 5	VUT
A	319377	Ultra High Vacuum Preparation and Analytical System - Custom Deposition Chamber SPECS	Komplexní zákaznická UHV aparatura	SPECS		VUT
A	319421	Laser dicer Oxford Lasers A-Series	Laserová řezačka A-SERIES 532	Oxford Lasers	A-Series	VUT
A	319448	Ultra High Vacuum Preparation and Analytical system - Evaporation cell for Ge and Si CreaTec Fischer	Křemíkové napařovací cely TUBO-HTC-63-10-WK-SHM	CreaTec Fischer		VUT
A	319449	Focused Ion Beam/Scanning Electron Microscope FEI Helios NanoLab 660	Mikroskop rastrovací dvojsvazkový-FIV/SEM	FEI	Helios NanoLab 660	VUT
A	319450	High resolution Scanning Electron Microscope FEI Verios 460L	Mikroskop elektronový vysokorozliš.rastrovací	FEI	Verios 460L	VUT
A	319451	High resolution (scanning) Transmission Electron Microscope FEI Titan Themis 60-300 cubed	Mikroskop elektronový vysokorozliš.transmisní	FEI	Titan Themis 60-300 cubed	VUT
A	319451	Ion polisher Fischione TEM Mill 1050		Fischione	Model 1050 TEM Mill	VUT
A	319451	Plasma cleaner Fischione 1020		Fischione	Model 1020 Plasma cleaner	VUT
A	319506	Mask Aligner, NanoImprint Lithography SÜSS MicroTec MA8/BA8 Gen3	Maskový litograf MA/BA8 Gen3	SÜSS MicroTec	MA8/BA8 Gen3	VUT
A	319507	Lithographic wetbench for resist coating SÜSS MicroTec	Litografický stůl VP8, 1xLabSpin8	SÜSS MicroTec		VUT

Příloha č. 1 Prováděcí dohody – Specifikace přístrojů a zařízení

Přístroj A/N	Inventární číslo	Celistvý název EN	Název dle účetního systému	Výrobce	Typové označení	Vlastník
A	319508	Resist coating and development system SÜSS MicroTec RCD8	Zařízení pro nanášení a vyvolávání vrstev RCD8T	SÜSS MicroTec	RCD8	VUT
A	319513	Dimple grinder Fischione 200	Důlkovač Model 200 Dimpling Grinder	Fischione	Model 200	VUT
A	319515	Cross section/broad beam ion polisher Leica EM TIC3X	Iontová leštička masivních vzorků Leica EM TIC3X	Leica	EM TIC3X	VUT
A	319516	TEM specimen grinding tool Fischione 160	Přípravek pro mechanické zmenšování Model 160	Fischione	Model 160	VUT
A	319517	Coater Leica EM ACE600	Systém pro povlakování SEM/TEM vzorků Leica	Leica	EM ACE600	VUT
A	319519	Ultrasonic TEM disc cutter Fischione 170	Ultrazvuková vyřezávačka Model 170 Ultrasonic Disk	Fischione	Model 170	VUT
A	319554	Wetbench for cleaning Stroza	Chemická lavice pro mytí - chemický box	Stroza		VUT
A	319555	Lithographic wetbench for development Stroza	Chemická lavice pro fotolitografii	Stroza		VUT
A	319556	Lithographic wetbench for stripping Stroza	Chemická lavice pro fotolitografii	Stroza		VUT
A	319557	Wetbench for process mask etching I Stroza	Chemická lavice pro leptání procesních masek	Stroza		VUT
A	319558	Wetbench for process mask etching II Stroza	Chemická lavice pro leptání procesních masek	Stroza		VUT
A	319559	Wetbench for wafer cleaning Stroza	Chemická lavice pro čištění waferů	Stroza		VUT
A	319560	Wetbench for semiconductor etching Stroza	Chemická lavice pro leptání polovodičů	Stroza		VUT
A	319561	Wetbench for metal etching Stroza	Chemická lavice pro leptání kovů	Stroza		VUT
A	319562	X-ray Photoelectron Spectroscopy Kratos Analytical Axis Supra	Rentgenová fotoelektronová spektroskopie	Kratos Analytical	Axis Supra	VUT
A	319580	Horizontal Thermal Reactors for atmospheric and low pressure chemical vapour deposition processes SVCS Process Innovation	Systém LPCVD - pro přípravu tenkých vrstev	SVCS Process Innovation		VUT
A	319581	Single Wafer Thermal Reactor System for metal organic chemical vapour deposition processes SVCS Process Innovation	Systém MOCVD - pro přípravu tenkých vrstev	SVCS Process Innovation		VUT
A	319824	Ion beam etching Scia Systems Coat 200	Zařízení pro leptání pomocí svazků iontů Scia Mill	Scia Systems	Coat 200	VUT
A	60164551	X-ray diffractometer with high brightness source Rigaku SmartLab 9kW	Difraktometr 9kW	Rigaku	SmartLab 9kW	MU
A	ZP 42116	Scanning Probe Microscope + microRaman + PhotoLuminescence system NT-MDT Ntegra Spectra + Solar II	Ramanský spektrograf s integrovanou AFM sestavou	NT-MDT	Ntegra Spectra + Solar II	MU
A	ZP 45338/60215876	Plasma enhanced chemical vapour deposition system on Si-based materials Oxford Instruments Plasma Technology PlasmaPro 100	Depozice z plynné fáze za přítomnosti plazmatu materiálu na bázi Si	Oxford Instruments Plasma Technology	PlasmaPro 100	MU
A	ZP 45339/60215878	High temperature plasma enhanced chemical vapour deposition system on C-based materials Oxford Instruments Plasma Technology NanoFab	Vysokoteplotní depozice z plynné fáze za přítomnosti plazmatu pro depozici materiálu na bázi uhlíku	Oxford Instruments Plasma Technology	NanoFab	MU
A	ZP 45361/60216287	Reactive ion etching of Si-based materials and deposition of thin films C-based material systém Oxford Instruments Plasma Technology PlasmaPro NGP 80	Reaktivní iontové leptání materiálů na bázi Si a depozice tenkých vrstev na bázi C	Oxford Instruments Plasma Technology	PlasmaPro NGP 80	MU
A	ZP 45535	nanoScanning Auger Microscopy/ Scanning electron microscopy with polarization analysis Scienta Omicron nanoSAM Lab	Rastrovací Augerova mikroskopie	Scienta Omicron	nanoSAM Lab	MU
A	ZP 45356	Ultra High Vacuum Preparation and Analytical System - Pulsed Laser Deposition TSST	Vysokovakuový preparační a analytický systém - pulsní laserová depozice	TSST		MU
A	ZP 42021/42022	MIR spectroscopic ellipsometer J. A. Woollam IR-VASE	MIR spektroskopický elipsometr	J. A. Woollam	IR-VASE	MU
A	ZP 42202	Atomic layer deposition system Ultratech/CambridgeNanoTech Fiji 200	Depozice atomárních vrstev	Ultratech/CambridgeNanoTech	Fiji 200	MU
A	ZP 45202/45215	Electron beam evaporator BESTEC	Vakuová napařovací aparatura	BESTEC	BESTEC-SPUTTER1	MU
A	ZP 45202/45215	High vacuum magnetron sputtering BESTEC	Vakuová napařovací aparatura	BESTEC	BESTEC-EVAP1	MU
A	ZP 43673/43674/43675	Plasma diagnostic system VAKUUM PRAHA	Experimentální PECVD	VAKUUM PRAHA	nXDS20i, VAT 10840-CE01,	MU
A	ZP 41953	Vacuum FTIR, IR microscope Bruker Vertex80v + Hyperion 3000	Infračervený spektrometr a infračervených mikroskop	Bruker	Vertex80v + Hyperion 3000	MU
A	ZP 42021/42022	NIR-UV spectroscopic ellipsometer J. A. Woollam V-VASE	NIR-UV spektroskopický elipsometr	J. A. Woollam	V-VASE	MU
A	ZP 43687	Vacuum ultraviolet spectrometer McPherson VUVAS 1000	Infračervený spektrofotometr umožňující měření transmisivity a reflektivity	McPherson	VUVAS 1000	MU
A	ZP 45540	NIR Optical Spectrometer Ocean optics NIRQuest 512	Vláknový spektrometr NIR	Ocean optics	NIRQuest 512	MU
A	ZP 45541	UV-VIS Optical Spectrometer Ocean optics JAZ 3-channel	Vláknový spektrometr UV-VIS	Ocean optics	JAZ 3-channel	MU
A		Stereomicroscope Zeiss Stemi 508		Zeiss	Stemi 508	VUT